

H30  
導入



# エックス線光電子分光装置 (K-Alpha)

郡山

## 装置の概要

### 【型式等】

装置名称：エックス線光電子分光装置  
メーカー：サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社  
型式：K-Alpha

### 【仕様】

- エックス線源：Al K $\alpha$ 線 マイクロフォーカスモノクロメーター 50 $\mu$ m~400 $\mu$ m
- 測定モード：光電子スペクトル、深さ方向、マッピング



※本装置は（公財）JKAの補助事業（機械工業振興補助事業）により導入されました。

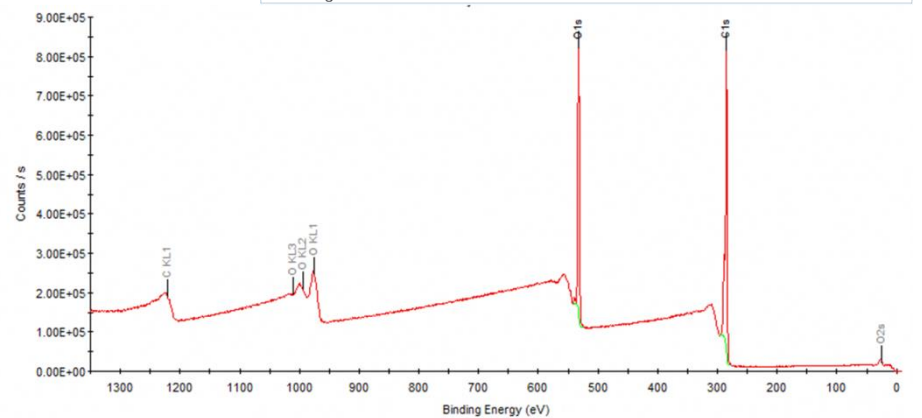
## 極表面の元素組成、化学結合状態評価が行えます！

### 【装置の特徴】

サーベイスペクトル測定、任意の元素を指定しての高分解能ナロースペクトル測定、深さ方向分析、角度分解分析、マッピング測定が可能なマイクロフォーカスタイプのXPSシステムです。

本システムでは、半導体、金属合金、セラミックス、ガラス、ポリマー、磁性材料および絶縁体の固体、粉末または薄膜試料の極表面の元素組成、化学結合状態を自動分析することが可能です。

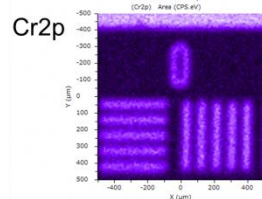
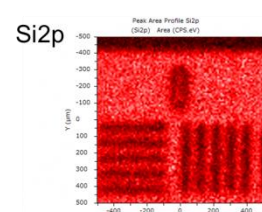
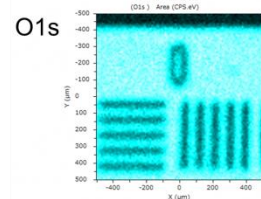
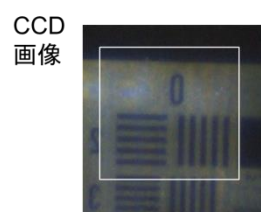
Name	Peak BE	Height CPS	FWHM eV	Area (P) CPS.eV	Atomic %
Al2p3 Metal	72.7	16772.7	0.6	11614.0	5.3
Al2p1 Metal	73.1	8386.4	0.6	5807.0	0.0
Al2p AlOx	75.9	47277.4	1.7	92603.2	28.3
C1s	286.7	24692.8	1.7	59708.7	11.6
O1s	533.0	242931.6	2.6	682778.6	54.7
Mg1s	1305.9	2082.7	1.7	4054.6	0.2



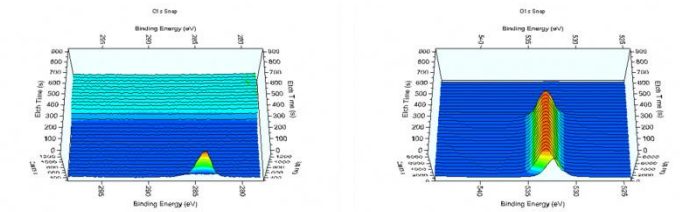
サーベイスペクトル (Alホイル)

### 【主な用途】

- 表面汚染物質の解析
- 機能性薄膜の構造評価
- 表面劣化、改質性の評価 etc...



マッピング (Crメッキ/SiO<sub>2</sub>)



深さ方向分析 (シリコン酸化膜)

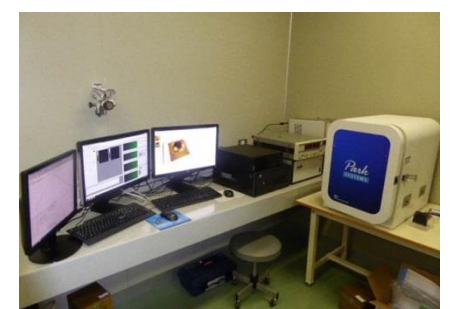
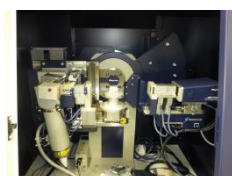
## 料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備使用	エックス線光電子分光装置 (K-Alpha)	1時間ごと	H31年4月1日に設定
依頼試験	エックス線光電子分光分析 定性分析	1試料につき	

〒963-0297

郡山市待池台1丁目1番地  
TEL: 024-959-1737 (工業材料科)  
FAX: 024-959-1761

## 併せて使うと効果的です！



水平型エックス線回折装置 ナノスケール物性測定システム  
(1,420円/時間) (6,900円/時間)